

開示の要約

光学式膜厚測定器の光量調整方法および研磨装置

- 5 光源の運用効率を向上させて、光源の寿命を延ばすことができる光学式膜厚測定器の光量調整方法が開示される。光学式膜厚測定器の光量調整方法は、光源の光量を監視し、監視された光量に基づいて、光源に印加される電圧を調整する。

図 5